

HG-C1000 应用案例

项目信息	应用	晶片清洗杯的检测	行业	半导体
	对象工件	半导体清洗杯	装置	清洗机
	项目概要	利用钹磁铁提起半导体清洗杯时，利用 HG-C来确认杯子底面是否保持水平。		

工序·应用概要	以往的方式	提案方式
	希望使用小型传感器，可透过窗口来观察提升的位移量。	<p>The diagram illustrates the proposed method. A grey rectangular '晶片清洗用杯' (wafer cleaning cup) is shown being lifted through a '窗口' (window). Below the window, two 'HG-C1050' sensors are positioned to detect the cup's displacement. A blue arrow points from the '以往的方式' (previous method) section to this diagram.</p>

问题点	竞争对手		解决方法！	客户满意度
	竞争型号			
	由于在装置的内侧安装有传感器，想要从外部进行设定，因此希望使用设定器。		可透过窗口对晶片清洗杯的位移量进行检测。	
		使用·提案机型	HG-C1050	